

管理機器一覧

浜松キャンパス共同利用機器センター 2016.4

総合研究棟									
No.	機器名(型番)	機器・用途	メーカー	アドバイザー	担当	サブ担当	設置部屋	課金単位	単位使用料
1	汎用SEM (S-3000N)	2次電子表面観察	日立ハイテック	友田	新村		104	半日	400
2	イオンコータ (SC-701AT)	SEM用金コート	サンヨー電子	村上	新村		104	1時間	100
3	TEM (JEM-2000RXII)	透過電顕	日本分光	坂元	高橋	村上	103	半日	1000
4	粉末XRD (RINT2200)	粉末X線回折	リガク	奥谷	新村		103	半日	400
5	高機能XRD (ATXG)	薄膜X線回折	リガク	脇谷	新村		103	半日	1000
6	汎用AFM (SPI3800)	最大20μ m四方の表面観察	セイコーインスツル	岩田	新村		102	半日	800
7	簡易AFM (VN-8010)	最大200μ m四方の表面観察	キーエンス	岩田	新村		102	半日	800
8	ESCA (ESCA-3400)	光電子による表面原子同定	島津	友田	友田		104	1日	2400
9	原子吸光 (Solar S4-AA)	吸光による元素分析	サーモエレクトロン	前田	草薙	新村	104	半日	800
10	元素分析 (Flash EA)	元素分析	サーモエレクトロン	戸田	草薙	新村	104	半日	800
11	熱分析 (DTG-60A)	耐熱温度・熱量の計測	島津	戸田	草薙	新村	104	半日	800
12	その場計測FE-SEM (JSM-7001F)	高分解能表面形態観察、元素分析、結晶相解析	日本電子、他	村上	新村		104	1時間	250
13	FE-EPMA (JXA-8530F)	微量組成分析	日本電子	村上	小山	村上	104	半日	1000
14	電気化学計測 (Solartron 1280Z)	交流インピーダンスサイクリックボルタンメトリ	東陽テクニカ	村上	草薙	新村	104	半日	400
15	ICP (Optima 2100DV)	溶液中の元素の定量	パーキンエルマー	新村	江上	新村	104	半日	1200
16	SPM (JSPM-5200)	AFMおよびSTM観察	日本電子	岩田	友田		102	半日	800
17	イオンミリング (EM RES101)	イオンビームを使ったTEM用試料の作製	LEICA		友田		104	半日	400
18	断面ポリッシャ (IB-09020 CP)	断面試料作製	日本電子		小山	友田	104	半日	400
19	デジタルマイクロスコープ (KH-8700)	35-2500倍、3D観察も可能	Hirox	下村	新村		104	1時間	100
20	蛍光X線 (EDX-8000)	元素分析	島津	新村	新村		104	1時間	100
21	SEM/EDS (JSM-6360LA/JED-2300)	表面観察と元素分析	日本電子	新村	新村		10F	半日	400
22	XRD (RINT Ultima II)	X線回折	リガク	下村	小山	村上	10F	半日	400
23	DSC (DSC60Plus)	示差走査熱測定	島津	根尾	草薙	新村	104	半日	800
24	NMR (JNM-AL300)	核磁気共鳴装置	日本電子	田中康	田中康	田中康	イノベ	1時間	200

ナノデバイス作製・評価センター									
No.	機器名(型番)	機器・用途	メーカー	アドバイザー	担当	サブ担当	設置部屋	課金単位	単位使用料
1	FE-SEM (JSM-6320F)	高分解能表面形態観察	日本電子	村上	友田	三宅	ナノデバイス	半日	800
2	分析FE-SEM (JSM-7001F)	高分解能表面形態観察、元素分析、結晶相解析	日本電子	村上	友田	三宅	ナノデバイス	1時間	250
3	FIB (JIB-4500)	イオンビーム加工	日本電子	下村	高橋	下村	ナノデバイス	半日	1000
4	広域AFM (XE-70)	Z軸応答範囲12μ mの表面観察	パークシステムズ	新村	新村		ナノデバイス	半日	600
5	薄膜XRD (RINT Ultima III)	粉末・薄膜のX線回折	リガク	下村	小山	下村	ナノデバイス	半日	1200
6	白金・カーボン コータ (SC701C)	SEM用コート	サンユー	友田	友田		ナノデバイス	1時間	100
7	STEM (JEM-2100F)	操作・透過電顕	日本電子	坂元	高橋	坂元	ナノデバイス	半日	1200
8	イオンスライサー (EM-09100 IS)	TEM用試料を作製	日本電子	坂元	高橋	坂元	ナノデバイス	1時間	100
9	ラマン (NRS-7100)	可視光による物質同定	日本分光	友田	高澤	友田	ナノデバイス	半日	800
10	UV-Vis分光光度計 (V-670)	紫外-可視光による物質同定	日本分光	村上	高澤	友田	ナノデバイス	半日	600
11	FT-IR (FT/IR-6300,IRT-7000)	赤外線による物質同定・マクロ、顕微、マッピング	日本分光	友田	高澤	友田	ナノデバイス	半日	800
12	蛍光分光 (FP-8600, FP-8700)	蛍光を用いた定性・定量	日本分光	川井	高澤	友田	ナノデバイス	半日	600
13	XPS (AXIS ULTRA DLD)	光電子による表面原子同定	島津	下村	友田	三宅	ナノデバイス	半日	1200

※その他、管理者

防犯カメラ(総合研究棟)	新村
防犯カメラ(ナノデバイス)	友田
静脈認証システム管理	新村
ナノデバイスカードキー管理	友田